



# ドライアイスブラスト装置

## 半導体用 ドライアイスブラスト装置の開発

- 半導体用途向けのため自動化装置・PassBox搭載
- 2流体方式ノズルで高い洗浄効果
- ウエハーの洗浄や薬液洗浄の代替えとして環境負荷の低減に貢献
- CO<sub>2</sub>液供給システムも確立



アプリケーション開発のため小型ブラスト装置を開発

➤ 様々な用途での評価が可能

【半導体】フラックス除去

【機械】マシニングセンタの冷却・除去

【材料】車載電池・テープ・その他

【部品】工学材料・レーザー関連部品・CMP工程

